

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-152890

(P2012-152890A)

(43) 公開日 平成24年8月16日(2012.8.16)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
B 8 1 B 3/00 (2006.01)	B 8 1 B 3/00	3 C 0 8 1
G 0 1 P 15/125 (2006.01)	G 0 1 P 15/125	4 M 1 1 2
H 0 1 L 29/84 (2006.01)	H 0 1 L 29/84	Z

審査請求 未請求 請求項の数 20 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2011-286840 (P2011-286840)
 (22) 出願日 平成23年12月27日 (2011.12.27)
 (31) 優先権主張番号 13/012, 643
 (32) 優先日 平成23年1月24日 (2011.1.24)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 504199127
 フリースケール セミコンダクター イン
 コーポレイテッド
 アメリカ合衆国 テキサス州 78735
 オースティン ウィリアム キャノン
 ドライブ ウェスト 6501
 (74) 代理人 100142907
 弁理士 本田 淳
 (72) 発明者 アンドリュウ シー, マクニール
 アメリカ合衆国 85225 アリゾナ州
 チャンドラー イースト カーラ ビス
 タ プレイス 2163

最終頁に続く

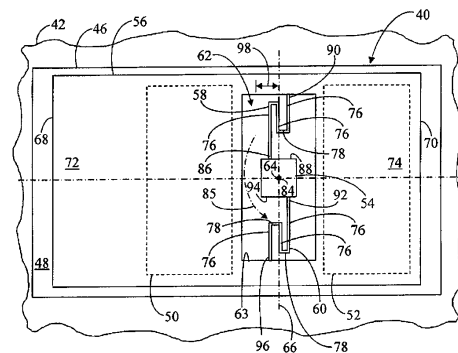
(54) 【発明の名称】 ジグザグ形のねじりばねを有するMEMSセンサ

(57) 【要約】

【課題】精度、小寸法、及びコスト効率的な製造を可能とするMEMSセンサ設計を提供する。

【解決手段】一態様では、微小電気機械システム(MEMS)センサは、複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばね(トーションばね)を備え、該ねじりばねは、可動要素すなわちブルーフマスを、その下にある基板の上に懸架している。さらなる一態様では、この複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばねは、熱によって誘起される応力による測定誤差を最小化すべく配向される。係るジグザグ形のねじりばねを有するMEMSセンサは、既存のMEMS製法を用いて製造可能である。

【選択図】図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

微小電気機械システム（MEMS）センサであって、
基板と、
基板の 1 つの表面の上に離間して配置された可動要素と、
基板の前記表面上に形成されたサスペンションアンカと、
可動要素とサスペンションアンカとを相互に接続する第 1 のジグザグ形のねじりばねと

、
可動要素とサスペンションアンカとを相互に接続する第 2 のジグザグ形のねじりばねと
を備え、第 1 および第 2 のジグザグ形のねじりばねは実質的に同一の形状を有し、第 2 の
ジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの中心を回転中心として第 1 のジグザ
グ形のねじりばねに対しほぼ回転対称となるように配向される、MEMS センサ。

10

【請求項 2】

第 2 のジグザグ形のねじりばねは、第 1 のジグザグ形のねじりばねに対して約 180 度
だけサスペンションアンカの中心の周りに回転された方向に配向される、請求項 1 に記載
の MEMS センサ。

【請求項 3】

可動要素は、可動要素の第 1 の端部と第 2 の端部との間に位置する回転軸に対して運動
することができ、

サスペンションアンカの中心は前記回転軸に位置し、

第 1 のジグザグ形のねじりばねはサスペンションアンカに接続された第 1 の端部を有し

20

、
第 2 のジグザグ形のねじりばねはサスペンションアンカに接続された第 2 の端部を有し

、
第 1 のジグザグ形のねじりばねの第 1 の端部および第 2 のジグザグ形のねじりばねの第
2 の端部は、それぞれ前記回転軸の両側に前記回転軸からほぼ等しい距離だけ離間して配
置されている、請求項 1 に記載の MEMS センサ。

【請求項 4】

可動要素は、可動要素の第 1 の端部と第 2 の端部との間に位置する回転軸に対して運動
することができ、

30

第 1 および第 2 のジグザグ形のねじりばねの各々は、前記回転軸に対しほぼ平行に配置
されている、請求項 1 に記載の MEMS センサ。

【請求項 5】

可動要素は、可動要素の第 1 の端部と第 2 の端部との間に位置する回転軸に対して運動
することができ、

第 1 および第 2 のジグザグ形のねじりばねの各々は、前記回転軸に対しほぼ平行に整合
して配置された複数のセグメントを含み、該セグメントは棒部材によって屈曲して連結さ
れる、請求項 1 に記載の MEMS センサ。

【請求項 6】

棒部材の各々は第 1 の長さを有し、セグメントは第 2 の長さを有し、第 1 の長さは第 2
の長さより小さい、請求項 5 に記載の MEMS センサ。

40

【請求項 7】

第 1 および第 2 のジグザグ形のねじりばねは各々少なくとも 3 つのセグメントを含む、請
求項 5 に記載の MEMS センサ。

【請求項 8】

可動要素は可動要素を通じて延びている開口部を備え、該開口部は可動要素の内縁部
によって画定されており、

サスペンションアンカは前記開口部の中心に配置されており、

第 1 のジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの第 1 の側に接続された第 1
の端部と、可動要素の内縁部に接続された第 2 の端部とを有し、

50

第2のジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの第1の側に対向する第2の側に接続された第3の端部と、可動要素の内縁部に接続された第4の端部とを有する、請求項1に記載のMEMSセンサ。

【請求項9】

可動要素は、可動要素の第1の端部と第2の端部との間に位置する回転軸に対して運動することができる、

前記センサは、基板上であって可動要素の下に配置された感知要素を含み、感知要素は、基板の1つの平面に対し垂直な軸に沿って前記回転軸の周りの第1の位置から第2の位置までの運動を可動要素の移動を検出するべく適合されている、請求項1に記載のMEMSセンサ。

【請求項10】

微小電気機械システム(MEMS)センサを備えるデバイスであって、

前記MEMSセンサは、

基板と、

基板の1つの表面の上に離間して配置された可動要素であって、該可動要素の第1の端部と第2の端部との間に位置する回転軸に対して運動することができる可動要素と、

基板の前記表面上に形成されたサスペンションアンカであって、前記回転軸に位置する中心を有するサスペンションアンカと、

可動要素とサスペンションアンカとを相互に接続する第1のジグザグ形のねじりばねと、

可動要素とサスペンションアンカとを相互に接続する第2のジグザグ形のねじりばねとを備え、第1および第2のジグザグ形のねじりばねは実質的に同一の形状を有し、第2のジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの中心を回転中心として第1のジグザグ形のねじりばねに対しほぼ回転対称となるように配向される、MEMSセンサ。

【請求項11】

第2のジグザグ形のねじりばねは、第1のジグザグ形のねじりばねに対して約180度だけサスペンションアンカの中心の周りに回転された方向に配向される、請求項10に記載のデバイス。

【請求項12】

棒部材の各々は第1の長さを有し、セグメントは第2の長さを有し、第1の長さは第2の長さより小さい、請求項10に記載のデバイス。

【請求項13】

第1および第2のジグザグ形のねじりばねは各々少なくとも3つのセグメントを含む、請求項10に記載のデバイス。

【請求項14】

可動要素は可動要素を通じて延びている開口部を備え、該開口部は可動要素の内縁部によって画定されており、

サスペンションアンカは前記開口部の中心に配置されており、

第1のジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの第1の側に接続された第1の端部と、可動要素の内縁部に接続された第2の端部とを有し、

第2のジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの第1の側に対向する第2の側に接続された第3の端部と、可動要素の内縁部に接続された第4の端部とを有する、請求項10に記載のデバイス。

【請求項15】

前記センサは、基板上であって可動要素の下に配置された感知要素を含み、感知要素は、基板の1つの平面に対し垂直な軸に沿って前記回転軸の周りの第1の位置から第2の位置までの運動を可動要素の移動を検出するべく適合されている、請求項10に記載のデバイス。

【請求項16】

微小電気機械システム(MEMS)センサであって、

10

20

30

40

50

基板と、

基板の1つの表面の上に離間して配置された可動要素であって、該可動要素を通じて延びている開口部を備え、該開口部は可動要素の内縁部によって画定されており、該可動要素は、該可動要素の第1の端部と第2の端部との間に位置する回転軸に対して運動することができる可動要素と、

基板の前記表面上に形成されたサスペンションアンカであって、前記開口部の中心に配置されているサスペンションアンカと、

可動要素とサスペンションアンカとを相互に接続する第1のジグザグ形のねじりばねであって、前記回転軸に対しほぼ平行に配置されており、サスペンションアンカの第1の側に接続された第1の端部と、可動要素の内縁部に接続された第2の端部とを有する第1のジグザグ形のねじりばねと、

10

可動要素とサスペンションアンカとを相互に接続する第2のジグザグ形のねじりばねであって、前記回転軸に対しほぼ平行に配置されており、サスペンションアンカの第1の側に対向する第2の側に接続された第3の端部と、可動要素の内縁部に接続された第4の端部とを有する第2のジグザグ形のねじりばねと、を備え、第1および第2のジグザグ形のねじりばねは実質的に同一の形状を有し、第2のジグザグ形のねじりばねは、サスペンションアンカの中心を回転中心として第1のジグザグ形のねじりばねに対しほぼ回転対称となるように配向される、MEMSセンサ。

【請求項17】

第2のジグザグ形のねじりばねは、第1のジグザグ形のねじりばねに対して約180度だけサスペンションアンカの中心の周りに回転された方向に配向される、請求項16に記載のMEMSセンサ。

20

【請求項18】

サスペンションアンカの中心は前記回転軸に位置し、

第1のジグザグ形のねじりばねの第1の端部および第2のジグザグ形のねじりばねの第3の端部は、それぞれ前記回転軸の両側に前記回転軸からほぼ等しい距離だけ離間して配置されている、

請求項16に記載のMEMSセンサ。

【請求項19】

第1および第2のジグザグ形のねじりばねの各々は、前記回転軸に対し平行に整合して配置された少なくとも3つのセグメントを含み、該セグメントは棒部材によって屈曲して連結されており、棒部材の各々は第1の長さを有し、セグメントは第2の長さを有し、第1の長さは第2の長さより小さい、請求項16に記載のMEMSセンサ。

30

【請求項20】

前記センサは、基板上であって可動要素の下に配置された感知要素を含み、感知要素は、基板の1つの平面に対し垂直な軸に沿って前記回転軸の周りの第1の位置から第2の位置までの運動を可動要素の移動を検出するべく適合されている、請求項16に記載のMEMSセンサ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

40

【0001】

本発明は、一般的には微小電気機械システム(MEMS)センサに関する。より詳細には、本発明は、サイズの減少および温度に誘起される誤差に対する影響の受けやすさの減少のためのジグザグ形のねじりばねを有するMEMSセンサに関する。

【背景技術】

【0002】

微小電気機械システム(MEMS)センサは、自動車、慣性航法システム、家庭用製品、種々のデバイスのための保護システムや、他の産業、科学、および工学システムなどの用途において広く使用されている。このようなMEMSセンサは、加速度、圧力、回転角、または温度などの物理的な状態を感知するために使用され、感知された物理的な状態を

50

表す電気信号を出力する。

【0003】

容量感知式MEMS設計は、加速環境および回転環境の両方における、また小型化されたデバイスにおける動作において非常に望ましく、さらにはコストが低いことによっても非常に望ましい。エネルギーの供給された回路の出力を変化させるために、容量式加速度計は加速に関連して電気容量における変化を感知する。1つの一般的な形態の加速度計は、「ティーター＝トーター」構成すなわち「シーソー」構成を有する2層の容量式トランスデューサである。この一般的に利用される型のトランスデューサは、基板上においてZ軸方向の加速下で回転する可動要素またはプレートをを用いる。この加速度計構造は、2つの別個の容量値を測定して差容量または相対容量を決定する。

10

【0004】

図1には、Z軸加速を感知するように適合されている従来技術のMEMS容量式加速度計20の平面図を示す。加速度計20は、従来のヒンジ式すなわち「シーソー」型センサとして形成されている。容量式加速度計20は、ほぼ平坦な面を有する基板22を備える。電極要素24, 26(破線によって示す)は、この基板22の平坦な面上に形成されている。これに加えて、この基板22の平坦な面上に、サスペンションアンカ28も形成されている。可動要素30(一般にブルーフマス、慣性錘などと呼ばれる)は、可動要素30とサスペンションアンカ28とを相互に接続する、一般にねじりばね32と呼ばれる1つ以上の回転可撓部(フレキシヤ)によって基板22上に可撓性に(すなわち、非剛直に)懸架される。図に示すように、開口部34は可動要素30を通じて延びており、サスペンションアンカ28は可動要素30の回転軸36に沿って開口部34のほぼ中心に配置されている。

20

【0005】

可動要素30は、加速に応答して回転軸36の周りを回転するように適合されているので、可動要素30の位置は、その下に位置する電極要素24, 26に対して変化する。より詳細には、ねじりばね32は、可動要素30に加わるZ軸加速に応答して、回転軸36と同軸であるねじりばね32自身の軸の周りのねじれ(すなわち、ずり応力)を受ける。この位置の変化によって、1組のキャパシタには、加速を表す差、すなわち差容量が生じる。通常、ねじりばね32は直棒であり、可動要素30が回転軸36の周りに回転し、その中立位置に復帰することを可能とするのに適切なばね定数を有するように形成されている。

30

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

精度、小寸法、及びコスト効率的な製造を可能とするMEMSセンサ設計を提供する。

【課題を解決するための手段】

【0007】

一態様では、微小電気機械システム(MEMS)センサは、複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばね(トーションばね)を備え、該ねじりばねは、可動要素すなわちブルーフマスを、その下にある基板の上に懸架している。さらなる一態様では、この複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばねは、熱によって誘起される応力による測定誤差を最小化するべく配向される。係るジグザグ形のねじりばねを有するMEMSセンサは、既存のMEMS製法を用いて製造可能である。

40

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】Z軸加速を感知するように適合されている従来技術のMEMS容量式加速度計の平面図。

【図2】一実施形態によるデバイスに含まれるMEMSセンサの平面図。

【図3】図2のMEMSセンサの側面図。

【図4】図2のMEMSセンサの一部を拡大した平面図。

50

【発明を実施するための形態】

【0009】

図2～4を参照する。図2には、一実施形態によるデバイス42に含まれるMEMSセンサ40の平面図を示す。図3には、MEMSセンサ40の側断面図を示す。図4には、MEMSセンサ40の一部を拡大した平面図を示す。MEMSセンサ40は、加速度計の形態では、矢印44によって表されるZ軸方向の加速を検出するように適合されており、「シーソー」型センサとして形成されている。デバイス42は、加速度測定を必要とする複数のデバイスのいずれを含んでもよい。それらのデバイスには、例えば、自動車システム、慣性航法システム、家庭用製品、種々のデバイスのための保護システム、携帯計算および通信デバイス、手持ち式のゲームコントローラや、他の多くの産業、科学、および工学システムを含む。

10

【0010】

MEMSセンサ40は、ほぼ平坦な面48を有する基板46を備える。電極要素50, 52およびサスペンションアンカ54は、基板46の平坦な面48上に形成される。可動要素56は、基板46の平坦な面48の上に離間して配置される。より詳細には、MEMSセンサ40は、可動要素56が基板46上に懸架されるように可動要素56とサスペンションアンカ54とを相互に接続する第1ジグザグ形のねじりばね58および第2ジグザグ形のねじりばね60を備える。MEMSセンサ40の構成部品は、例えば、堆積、パターンニング、およびエッチングを含む、既存のまたは将来の技術によるMEMS製造設計規則および製法を用いて形成され得る。

20

【0011】

図に示すように、開口部62は可動要素56を通じて延びており、可動要素56の内縁部63によって画定される。サスペンションアンカ54は、可動要素56の第1端部68と第2端部70との間において、開口部62のほぼ中心64に可動要素56の回転軸66に沿って配置される。

【0012】

シーソー型加速度計としての動作が意図される場合、回転軸66の1つの側における可動要素56の第1部分72は、回転軸66の別の側における可動要素56の第2部分74より相対的に大きな質量を有するように形成される。例示的な一実施形態では、第1部分72のより大きな質量は、第1部分72が第2部分74より長くなるように回転軸66を移動させることによって形成される。しかしながら、第1部分72と第2部分74との間の質量の差が回転軸を移動させることによって形成されることに代え、代替の一実施形態では、この質量の差は、材料の追加の層によって第1部分72に質量を追加すること、第1部分72に対して第2部分74から質量を除去すること等によって達成されてよい。可動要素56は加速44に応答して回転軸66の周りに回転するように適合されているので、可動要素56の位置は、その下にある感知要素(電極要素)50, 52に対して変化する。この位置の変化によって、その差が加速44を表す1組の容量、すなわち差容量が生じる。

30

【0013】

第1および第2のジグザグ形のねじりばね58, 60の各々は、ほぼ等しい形状および同様の寸法を有している。第1および第2のジグザグ形のねじりばね58, 60の各々は、回転軸66とほぼ平行に整合して配置されている複数のセグメント76を備えるねじりばね58, 60の各々におけるセグメント76は、棒部材によって蛇行形状、すなわちジグザグ形に接続されており、ねじりばね58, 60の「折り曲げられた」構成を形成する。図示した例では、第1および第2のねじりばね58, 60の各々は、3つのセグメント76を備える。しかしながら、代替のジグザグ形の構成は、3つ以上のセグメント76を備えてよい。

40

【0014】

一実施形態では、棒部材78は、回転軸66に対しほぼ垂直である一方、基板46の平坦な面48に対し平行である。図4の拡大した平面図に特に示すように、各棒部材78の

50

長さ 80 は、セグメント 76 の各々の長さ 82 より有意に短い。したがって、棒部材 78 の材料特性は、第 1 および第 2 のジグザグ形のばね 58, 60 のねじれ能力に有意に寄与しない。むしろ、

回転軸 66 に対し平行に配置されたセグメント 76 を組み合わせた全体によって、加速 44 に応答して回転軸 66 の周りに可動要素 56 を回転させることを可能とする望ましい効果が得られる。実際に、各セグメント 76 の長さ 82 の合計に等しい全長を有するねじりばね 32 (図 1) など、直棒のねじりばねとほぼ同じ捻ればね定数が得られる。しかしながら、3つのセグメント 76 の「ジグザグ形」の構成のため、第 1 および第 2 のねじりばね 58, 60 によって占有される空間の大きさは、同じ捻ればね定数を有する従来の直棒ねじりばねの約 1/3 である。

10

【0015】

MEMS センサ用途では、より低い TCO (temperature coefficient of offset) が要求される。TCO は、熱応力が MEMS センサなどの半導体デバイスの性能にどれくらい影響を与えるかの測度である。高い TCO は、熱によって誘起される応力が相当大きいことや、MEMS デバイスがそうした応力の影響を相当受けやすいことを示す。MEMS センサ用途のパッケージングでは、熱膨張率の異なる材料が使用されることが多くある。したがって、望ましくないことに高い TCO が製造時または動作時に発生し得る。これに加えて、最終用途においてパッケージングされた半導体デバイスをプリント回路板上に半田付けすることによって生じる場合もある。応力と MEMS デバイスの材料特性との組み合わせによって、基板 46 に歪み (すなわち、変形) が生じ得る。サスペンションアンカ 54 にも、その下に位置する基板 46 を介し、この歪みまたは変形が生じ得る。サスペンションアンカ 54 における歪みによって、回転軸 66 の周りに可動要素 56 の回転が生じ、これによって測定精度が低下するので、容量式加速度計 40 の出力に不利な影響が与えられる。

20

【0016】

従来では、MEMS センサにおける要素は、通常、鏡映対称であるように配置されており、要素は 1 つの対称軸に対して配置されている。対称軸とは、幾何学的な線であり、その対称軸に沿って折り返した場合に一方の部分が他方の部分に一致するように図形を 2 つの部分に分ける線である。従来技術の MEMS センサ 20 (図 1) の構成部品は、鏡映対称に配置されている。残念なことに、ジグザグ形のねじりばねを鏡映対称に配置しても、TCO 効果のため、望ましくない大きな歪みおよび測定程度の低下が生じ得る。

30

【0017】

したがって、第 1 および第 2 ジグザグ形のねじりばねは鏡映対称に配置されていない。むしろ、図 2 に示すように、サスペンションアンカ 54 における歪みによって測定精度の低下が生じるという問題に対処するために、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 は、サスペンションアンカ 54 の中心 84 の周りに第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 に対してほぼ回転対称に配置される。本明細書において用いられる用語「回転対称」は、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 が第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 に対して中心 84 の周りに回転されるとともに、第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 と「同じに見える」ことを意味する。すなわち、第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 上の各点は、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 上に、中心 84 からの距離が同じであり、ただし反対方向にある一致点をそれぞれ有する。この回転対称性は、図 2 において矢印 85 によって表される。一実施形態では、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 は、第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 に対してサスペンションアンカ 54 の中心 84 の周りに約 180 度だけ回転された方向に配置される。この構成は、「2 回対称性」とも呼ばれる。

40

【0018】

第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 は、サスペンションアンカ 54 の第 1 の側 88 に接続された端部 86 と、可動要素 56 の内縁部 53 に接続された別の端部 90 とを有する。同様に、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 は、サスペンションアンカ 54 の第 1 の側 88 に対向するサスペンションアンカ 54 の第 2 の側に接続された端部 92 を有する。第 2

50

のジグザグ形のねじりばね 60 の別の端部 96 も、可動要素の内縁部 63 に接続されている。図に示す実施形態では、第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 の端部 86 , 90 は、互いに対して整合して配置されていない。むしろ、それらの端部 86 , 90 は、対称軸 66 に対し、側方に互いから離間するように配置されている。同様に、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 の端部 92 , 96 は、対称軸 66 に対し、側方に互いから離間するように配置されている。

【0019】

第 1 および第 2 ねじりばね 58 , 60 の回転対称性配置によって、いずれもサスペンションアンカ 54 に接続されている第 1 のジグザグ形のねじりばねの端部 86 および第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 の端部 92 は、対称軸 66 の対向する側において等しい距離 98 だけ離間して配置される。したがって、第 1 のジグザグ形のねじりばね 58 の端部 86 においてサスペンションアンカ 54 を通じて与えられる歪みは、第 2 のジグザグ形のねじりばね 60 の端部 92 においてサスペンションアンカ 54 を通じて与えられる、ほぼ等しい逆の歪みによって相殺される。この結果、この回転対称性配置によって、TCO 効果による測定誤差が有効に打ち消される。

10

【0020】

一実施形態では、第 1 および第 2 のねじりばね 58 , 60 は、回転軸 66 の対向する側に配置された対応する端部 86 , 92 を有する。しかしながら、代替の実施形態では、サスペンションアンカ 54 に対する 2 つのジグザグ形のねじりばねの取付点は回転軸 66 上にある一方、可動要素 56 に対するジグザグ形のねじりばねの取付点は、回転軸 66 の対向する側に等しい距離だけ離間して配置されてよいことが理解される。さらに別の実施形態では、各ジグザグ形のねじりばねは互いに対して回転対称に配置されていればよく、各ジグザグ形のねじりばねの端部が回転軸 66 上に配置される必要はない。

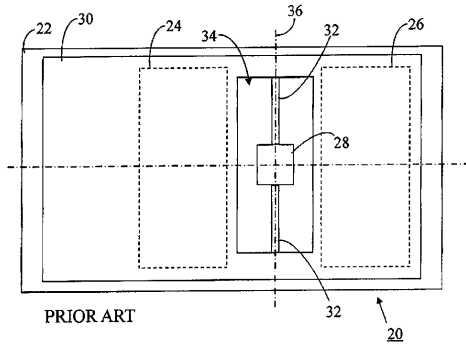
20

【0021】

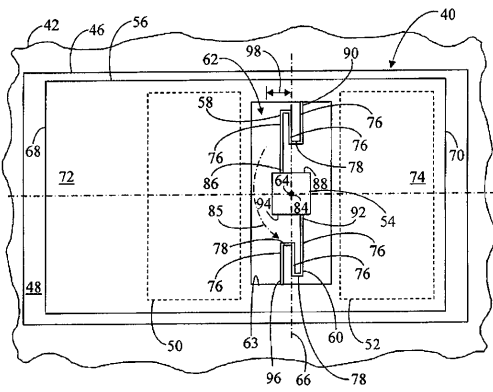
本明細書に記載の実施形態では、微小電気機械システム (MEMS) センサは、複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばね (トーションばね) を備え、該ねじりばねは、可動要素すなわちブルーフマスを、その下にある基板の上に懸架している。この複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばねによって、等しい捻ればね定数を有する直棒のねじりばねに対して寸法が低減される。これに加えて、この複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばねは、熱によって誘起される応力による測定誤差を最小化するべく回転軸に対して配向される。ばねの配向は回転対称性に基づいており、1 つのジグザグ形のねじりばねは別のジグザグ形のねじりばねに対し、1 つのジグザグ形のねじりばね上の各点が別のジグザグ形のねじりばね上に、サスペンションアンカの中心からの距離が同じであり、ただし反対方向にある一致点をそれぞれ有するように、配向される。したがって、複数のセグメントを有するジグザグ形のねじりばねは、全体としてより小さな面積を有する MEMS センサ設計により実装可能であるとともに、厳密な TCO 仕様を満たすことが可能である。さらにまた、このような MEMS センサは、従来の製法を利用して、低コスト、小型、単一ダイのトランスデューサとして実装可能である。

30

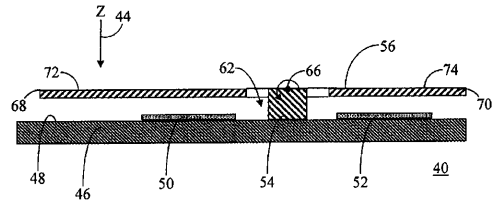
【 図 1 】



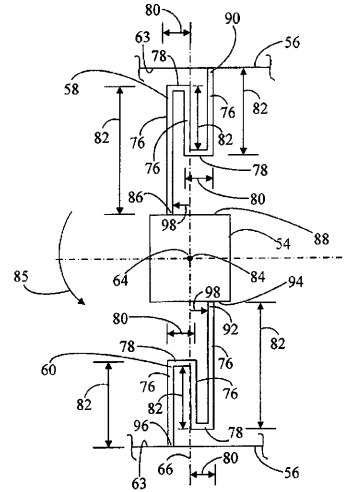
【 図 2 】



【 図 3 】



【 図 4 】



フロントページの続き

(72)発明者 ゲイリー ジー . リー

アメリカ合衆国 8 5 2 8 6 アリゾナ州 チャンドラー サウス キャリッジ レーン 1 6 4
1

Fターム(参考) 3C081 AA11 AA18 BA44 BA46 BA47 BA76 EA02

4M112 AA01 AA02 BA07 CA21 CA22 CA24 CA31 DA02 DA15 FA01

FA05 FA09 FA20 GA01